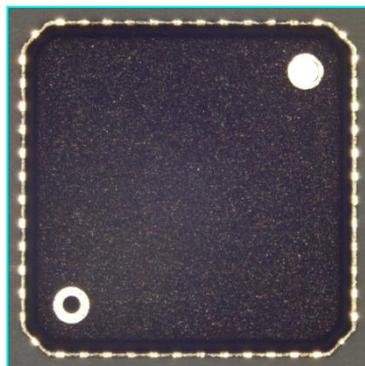


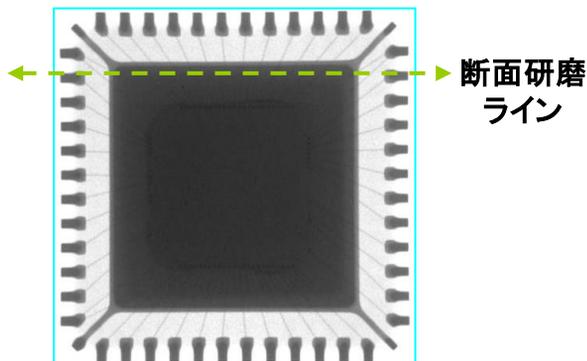
銅ワイヤパッケージ断面観察事例

乾式研磨・クロスセクションポリッシャにより
銅ワイヤにダメージなく断面観察が可能です。

PKG外観



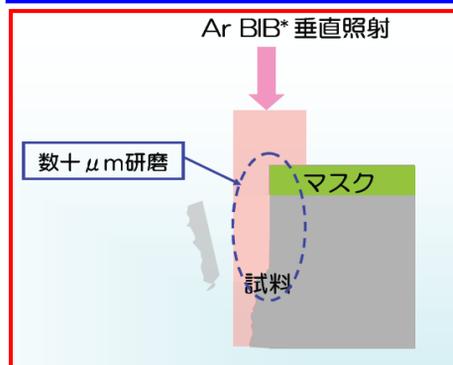
X線観察



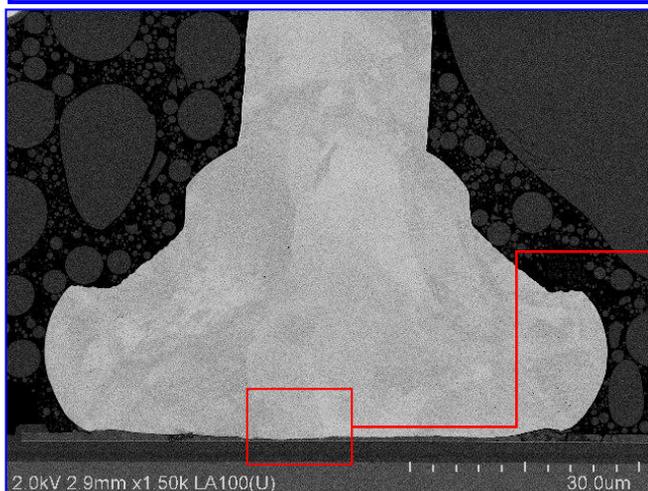
クロスセクションポリッシャ加工条件

試料サイズ: 11mm(幅) × 10mm(長さ) × 2mm(厚さ)
加工領域: 1000um
加工速度: 100um/Hr ※Siレート 5KVの場合
イオン銃: ペニング型アルゴンイオン銃
加速電圧: 2~6KV

クロスセクションポリッシャ原理



FE-SEMによる銅ワイヤボンディング状態の観察



銅ワイヤ界面のダレ、キズがない断面加工観察が行えます。
チャネリングコントラストにより、結晶粒状態の観察も可能です。

内藤電誠工業株式会社 評価解析事業部

213-0011 川崎市高津区久本3-9-25

TEL: 044-811-5496

FAX: 044-850-5851

<https://www.lab.ndk-grp.co.jp/>